

高真空蒸着装置 RD-1500



高真空蒸着装置RD-1500は金属を成膜するための蒸着装置です。

抵抗加熱電極が6対ありますので、多層膜や同時成膜が可能です。排気系動作は自動。

水晶振動式膜厚計も標準で搭載しております。

高真空蒸着装置 RD-1500 仕様

- 到達圧力 $\times 10^{-5}$ Pa台以下※ワーク挿入時・常温時
- 排気速度 大気圧から60分で 2.0×10^{-4} Pa※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空漏洩量 1.0×10^{-10} Pa \cdot m³/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 $\phi 500$ mm \times 625mmH SUS304 電解研磨処理 前扉方式
- 蒸着機構 抵抗加熱方式6対(最大2源同時可能)
AC10V0~250A
制御方式:サイリスタ制御
電流計・可変ボリューム
- 基板形状 $\phi 290$ mm 4インチウエハー4枚設置可能(ご希望形状に対応可能)
- 基板回転 回転数:0~15rpm
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:333L/min[50Hz]
油拡散ポンプ:1100L/sec 水冷バツフル付
- 真空計 広帯域真空計
- 操作方法 排気系全自動(手動操作も可能)
- 制御系 独立制御盤型:タッチパネル/シーケンサー/サイリスタユニット/各種コントローラ
- ユーティリティ 電気:AC200V単相50A
冷却水:2L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
装置本体:950mmW \times 1000mmD \times (1922)mmH
制御盤:570mmW \times 1000mmD \times (1593)mmH